

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成28年1月7日(2016.1.7)

【公表番号】特表2008-535275(P2008-535275A)

【公表日】平成20年8月28日(2008.8.28)

【年通号数】公開・登録公報2008-034

【出願番号】特願2008-504617(P2008-504617)

【国際特許分類】

H 01 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/60 3 1 1 S

H 01 L 21/60 3 1 1 Q

H 01 L 21/60 3 1 1 T

【誤訳訂正書】

【提出日】平成27年11月11日(2015.11.11)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0038

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0038】

図5の実施形態では、全部で6つの移送ツール62から67が一列配列69で組み合わされている。勿論、異なる数の移送ツールを一列配列で組み合わせることも、行列パターン75(図6)を作り出すように、この列配列を別の列配列70から74と組み合わせることも可能である。図5の実施形態では、列配列69内の個々の移送ツール62から67の互いに対する相対的な位置合わせを調整するために調整機構76が設けられ、これらによって移送ツール62から67の長手方向軸を互いに対して位置合わせし、そして、移送ツール62から67の接触先端部1と基準表面Fとの間の一貫した距離aを作り出すように移送ツール62から67の均一な高さ調整が可能になる。